

## 구미전자정보기술원 저활용 연구시설장비 이전신청 안내

○ 연구시설장비 이전 절차

단계 (예상 일정)	주요 내용	수행 주체
장비이전 신청 (~ 2022년 3월)	· ZEUS 나눔터 이전 신청(www.zeus.go.kr) · 기술원 방문 및 장비상태 확인	양수기관
장비이전심의위원회 (~ 2022년 3월)	· 장비이전 타당성 검토 · 이전기관 및 이전지원금액 결정	ZEUS
장비이전 (~ 2022년 4월)	· 장비이전(양수기관) 및 공고 종료(GERI)	양수기관
이전장비 사후관리 (~ 계속)	· 이전완료 후, 장비활용실적 조사	양수기관

○ 간략한 이전 순서

- ① ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr) 나눔터 장비조회
- ② 구미전자정보기술원 방문 및 장비상태 직접 확인
- ③ ZEUS 장비활용종합포털에서 해당 장비 이전 신청
- ④ 이전타당성 검토 및 지원금액 결정  
- 지원금액으로 장비수리, 장비이전, 장비교육 가능
- ⑤ 장비이전 및 사후관리

○ 문의 : ZEUS(1670-0925), GERI(054-479-2185, nsy@geri.re.kr)

## 구미전자정보기술원 ZEUS 나눔터 이전장비목록(총 28대)

구분	연구시설·장비명 (모델명)	취득일자	장비용도	장비상태 등급
1	디지털방송전송기 (SFU)	2008-02-05	모바일/디지털 TV의 표준 신호 발생하여, TS를 입력받아 품질 측정	S
2	비디오성능분석기 (VT700T/VM6000)	2008-04-01	HD, SD Analog Video 출력의 품질을 측정	S
3	USB프로토콜 분석기 (2500H)	2006-02-01	USB2.0 규격으로 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1.5 Mb/s 지원	S
4	무선랜분석기 (AiroPeek NX)	2006-03-02	실시간 패킷분석 및 통계용으로 사용	S
5	유도결합플라즈마 식각장치 (REDOX-200)	2008-03-05	소자 공정중 패턴된 영역의 식각공정 수행, 반도체 소자, 태양전지, 트랜지스터 소자의 식각	B
6	습식세정장비 (MSC-08)	2008-03-21	소자공정 중 샘플 세척 및 클리닝 공정 수행	B
7	가속용매 전처리시스템 (ASE 200)	2007-02-26	고체 및 반고체(semi-solid) 시료에서 화합물을 빠르게 추출, 시간, 용매, 비용을 절약하고 Soxhlet 및 음파처리와 같은 기존 기법에 비해 시간 단축에 사용	B
8	전해연마기 (-)	2007-03-13	시편제작시 사용하는 연마기	B
9	원심분리기 (Micro 17R Plus)	2005-01-28	고속원심분리기를 통하여 층상분리 및 불순물 분리 용도	B
10	레이저패턴장비 (MACH600)	2010-08-08	저항막 방식의 터치센서 제작용으로 ITO박막의 배선전극 분리를 위한 라인에칭용	C
11	나노인덴테이션 (G200)	2008-06-01	재료의 경도 및 탄성계수 측정	C
12	초가속수명시험기 (VTC-6)	2007-07-04	부품, 제품의 고장을 빠른 시간내에 평가하기 위한 장비	C
13	투과율측정장비 (MCPD7000)	2004-02-27	투과율 분석용	C
14	임프린트장비 (-)	2009-01-30	마스터 몰드를 이용하여 임프린팅 방식을 통해 유전체등의 다양한 패턴을 형성 공정장비로 사용	C

15	E-Beam 증착장비 (KaRon-1B-1500)	2007-10-16	이온빔을 이용한 산화물 및 금속 전극 형성을 위한 박막증착장비	C
16	콤마코터 (STC)	2008-01-09	페이스트소재의 성능평가를 위해 닥터블레이드 방식의 후막형성 공정장비로 사용	C
17	마스크정렬노광기 (MDA-8000)	2007-10-31	포토리지스트(PR)을 이용하여 UV노광 방식을 통해 다양한 패턴을 형성 공정장비로 사용	C
18	전자식별 테스트시스템 (NI PXI-1044)	2008-03-28	requeency range : TX(250 kHz ~ 2.7 GHz), RX(9 kHz ~ 2.7 GHz) 에서의 RFID 송수신 Test 용도	C
19	입도분석기 (Zetasizer Nano ZS)	2005-01-30	시료를 액상에 잘 분산시켜서 레이저의 회절을 이용하여 시료의 입자크기, 입도분포 등을 측정	C
20	열중량 분석기 (SDT Q600)	2005-01-03	시료를 승온, 냉각, 등온 변화 시켰을 때, 시료의 흡수/방출한 에너지(열), 무게 변화 측정	C
21	접촉각측정기 (DM 700)	2007-02-27	접촉각 측정	C
22	고온젖음성측정장치 (HMS-1700)	2006-12-19	고온에서의 젖음성 측정	C
23	FPD 성능평가시스템 (FPMS-IVL32)	2007-10-31	측정 영역에 휘도 측정 시 이동장치	C
24	휘도계 (CS-1000A)	2003-12-31	휘도측정	C
25	광전자분광기 (-)	2005-01-13	물질의 특성(결정구조, 불순물 농도) 분석	C
26	초순수제조장치 (Milli-Q)	2008-02-12	초순수 제조용 장치	C
27	페이스트액성 특성평가장치 (제이오텍)	2005-01-28	페이스트의 PH 측정용	C
28	고정밀반자동인쇄기 (WISP-2020VSP)	2006-01-27	페이스트 소재르 이용하여 스크린프린팅 방식을 통해 전극 및 다양한 패턴을 형성 공정	C

※ 장비상태등급

- S : 현재 정상 사용중으로 이전 후 바로 사용가능
- A : 장비가액의 10% 이내에서 수리 후 정상 작동 확실
- B : 장비가액의 10% 초과 30% 이하로 수리 후 정상 작동 확실
- C : 수리 후 정상 작동 불확실, 부품재활용으로 활용가능